(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 8. April 2004 (08.04.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/029544 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7:

_ _ .

- G01B 9/02 (72) Erfinder; und
 - (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MARCHAL, Dominique [FR/CH]; Route de Bellevue 9, CH-1337 Vallorbe (CH). DUVOISIN, Marc-Henri [CH/CH]; Chemin de la Fontanne 6, CH-1028 Préverenges (CH). BREIDER, Dominique [FR/CH]; Ch. au Vernaz 4, CH-1112 Echichens (CH). DRABAREK, Pawel [DE/DE]; Parkstrasse 16/5,

(22) Internationales Anmeldedatum:

(21) Internationales Aktenzeichen:

28. März 2003 (28.03.2003)

PCT/DE2003/001032

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

102 44 553.2 25. September 2002 (25.09.2002) DI

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): ROBERT BOSCH GMBH [DE/DE]; Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): BR, CN, JP, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

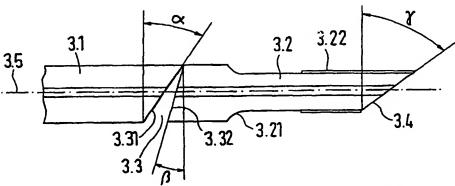
Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

75233 Tiefenbronn (DE).

. [Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: INTERFEROMETRIC MEASURING DEVICE
- (54) Bezeichnung: INTERFEROMETRISCHE MESSEINRICHTUNG



(57) Abstract: The invention relates to an interferometric measuring device for detecting the shape, roughness, and distance of the surface of an object (8) to be measured by means of a modulation interferometer (2) to which short coherent radiation is supplied by a source of radiation (1) and which comprises a first beam splitter (2.3) for splitting the supplied radiation into a first partial beam (2.1) that is guided across a first arm and a second partial beam (2.1') that is guided across a second arm. The light phase or light frequency of one of said partial beams is shifted relative to the other partial beam by means of a modulation device (2.2, 2.2'), said partial beam traveling across a delay loop (2.9'), whereupon the partial beams are reunited at another beam splitter (2.10) of the modulation interferometer (2).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf eine interferometrische Messvorrichtung zum Erfassen der Form, der Rauheit oder des Abstandes der Oberfläche eines Messobjektes (8) mit einem Modulationsinterferometer (2), dem von einer Strahlungsquelle (1) kurzkohärente Strahlung zugeführt wird und das einen ersten Strahlteiler (2.3) zum Aufteilen der zugeführten Strahlung in einen über einen ersten Arm geführten ersten Teilstrahl (2.1) und einen über einen zweiten Arm geführten zweiten Teilstrahl (2.1') aufweist, von denen der eine gegenüber dem anderen mittels einer Modulationseinrichtung (2.2, 2.2') in seiner Licht-Phase oder Lichtfrequenz verschoben wird und eine Verzögerungsstrecke (2.9') durchläuft, und die anschliessend an einem weiteren Strahlteiler (2.10) des Modulationsinterferomters (2) vereinigt werden.



WO 2004/029544 A1



Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

PCT/DE2003/001032

5

10

15

1

Interferometrische Messeinrichtung

Die Erfindung bezieht sich auf eine interferometrische Messvorrichtung zum Erfassen der Form, der Rauheit oder des Abstandes der Oberfläche eines Messobjektes mit einem Modulationsinterferometer, dem von einer Strahlungsquelle kurzkohärente Strahlung zugeführt wird und das einen ersten Strahlteiler zum Aufteilen der zugeführten Strahlung in einen über einen ersten Arm geführten ersten Teilstrahl und einen über einen zweiten Arm geführten zweiten Teilstrahl aufweist, von denen der eine gegenüber dem anderen mittels einer Modulationseinrichtung in seiner Licht-Phase oder Lichtfrequenz verschoben wird und eine Verzögerungsstrecke durchläuft, und die anschließend an einem weiteren Strahlteiler des Modulationsinterferomters vereinigt werden, mit einer von dem Modulationsinterferometer räumlich getrennten und mit diesem über eine Lichtleitfaseranordnung gekoppelten oder koppelbaren Messsonde, in der die vereinigten

Teilstrahlen in einen durch eine Sonden-Lichtleitfasereinheit mit einer schrägen objektseitigen Austrittsfläche zu der Oberfläche geführten Messstrahl und einen Referenzstrahl aufgeteilt und wonach der an der Oberfläche reflektierte Messstrahl und der an einer Referenzebene reflektierte Referenzstrahl überlagert werden, und mit einer Empfängervorrichtung und einer Auswerteeinheit zum Umwandeln der ihr zugeleiteten Strahlung in elektrische Signale und zum Auswerten der Signale auf der Grundlage einer Phasendifferenz.

Stand der Technik

15

20

5

10

Eine derartige interferometrische Messeinrichtung ist in der DE 100 57 539 A1 gezeigt. Bei dieser bekannten Messvorrichtung ist die interferometrische Messvorrichtung einerseits in ein Modulationsinterferometer und andererseits in eine Messsonde mit einer weiteren Interferometereinheit aufgeteilt. In der Messsonde ist eine Sonden-Lichtleitfasereinheit mit einer objektseitigen Austrittsfläche vorgesehen, die z.B. abgeschrägt sein kann. Nähere Ausführungen sind diesbezüglich nicht gemacht. Im Übrigen arbeitet eine derartige interferometrische Messvorrichtung in der nachfolgend im Zusammenhang mit der DE 198 19 762 A1 näher beschriebenen Weise.

25

30

Eine weitere interferometrische Messvorrichtung ist in der DE 198 19 762 A1 angegeben. Bei dieser Messvorrichtung ist ein Teil, das sogenannte Modulationsinterferometer, räumlich von der eigentlichen Messsonde getrennt und mit dieser optisch über eine Lichtleitfaseranordnung verbunden, so dass die Messsonde an sich als relativ einfach aufgebaute, leicht handhabbare Einheit aus-

10

15

20

25

geführt werden kann. Dem Modulationsinterferometer wird eine breitbandige, kurzkohärente Strahlung zugeführt, die am Eingang des Modulationsinterferometers mittels eines Strahlteilers in zwei Teilstrahlen aufgeteilt wird, von denen der eine gegenüber dem anderen mittels einer Modulationseinrichtung, beispielsweise einem akustooptischen Modulator, in seiner Licht-Phase oder Licht-Frequenz verschoben wird. Einer der beiden Teilstrahlen durchläuft in dem Modulationsinterferometer ein Verzögerungselement, das eine optische Wegdifferenz der beiden Teilstrahlen erzeugt, die größer ist als die Kohärenzlänge der kurzkohärenten Strahlung. In der Messsonde wird in einem Messzweig bezüglich eines Referenzzweigs eine weitere optische Wegdifferenz in der Weise erzeugt, dass die durch das Verzögerungselement bewirkte Wegdifferenz kompensiert wird und somit eine Interferenz der von der Referenzebene des Referenzzweigs kommenden Referenzstrahlung und der von der Objektoberfläche in dem Messzweig zurückkommenden Strahlung entsteht, die nachfolgend ausgewertet wird, um die gewünschte Oberflächeneigenschaft (Form, Rauhigkeit, Abstand) über eine Phasenauswertung zu ermitteln. In der Messsonde sind der Messzweig und der Referenzzweig bei einem Ausführungsbeispiel in einem gemeinsamen Lichtweg (common path) angeordnet, wobei zum Bilden des Messzweiges und des Referenzzweiges ein teildurchlässiges optisches Element vorgesehen ist.

Eine ähnliche interferometrische Messeinrichtung mit einem derartigen Modulationsferometer und einer daran über eine Lichtleitfaseranordnung angeschlossenen Messsonde ist auch in der DE 198 08 273 A1 angegeben, wobei mittels einer Empfängervorrichtung in einer Strahlzerlegungs- und Strahlempfangseinheit eine Aufspaltung der zur Interferenz gebrachten Strahlung in Strahlungsanteile

unterschiedlicher Wellenlängen erfolgt, um daraus eine synthetische Wellenlänge zu bilden und den Messbereich (Eindeutigkeitsbereich) zu vergrößern.

5

10

15

20

Bei den vorstehend genannten interferometrischen Messeinrichtungen, die auf dem Prinzip der Heterodyninterferometrie beruhen, aber die Eigenschaften einer breitbandigen, kurzkohärenten Strahlung ausnutzen, weist das als Mach-Zehnder-Interferometer ausgebildete Modulationsinterferometer eine Anordnung klassischer optischer Bauteile auf, wie eine vor dem eingangsseitigen Strahlteiler liegende Kollimationsoptik, den eingangsseitigen und ausgangsseitigen Strahlteiler und Umlenkspiegel. Die Teilstrahlen erfahren dabei mehrere Reflexionen an den Strahlteilerflächen und an den Spiegeln, bevor sie in die optische Lichtleiterfaseranordnung eingekoppelt werden. Die optischen Bauelemente müssen mit hoher Genauigkeit positioniert werden, da jeder Winkelfehler sich bei der Reflexion doppelt auswirkt. Dabei ist eine dauerhafte Justierung schwer sicher zu stellen. Auch im Zusammenhang mit der Einfügung einer Glasplatte zum Ausgleich von optischen Unsymmetrien können sich zusätzliche Schwierigkeiten bei der Justierung ergeben. Mit diesen Schwierigkeiten ist ein aufwendiger Aufbau verbunden, wobei außerdem eine genaue Anpassung an die Eigenschaften der Messsonde erforderlich ist.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine interferometrische Messeinrichtung der eingangs genannten Art bereitzustellen, die mit vereinfachtem Aufbau eine möglichst hohe Messgenauigkeit erreichen lässt.

10

15

20

25

Vorteile der Erfindung

Diese Aufgabe wird mit den Merkmalén des Anspruchs 1 gelöst. Hiernach ist vorgesehen, dass der Neigungswinkel der Austrittsfläche gegenüber der Normalen der optischen Sondenachse mindestens 46° beträgt.

Mit dieser Ausbildung der Austrittsfläche wird ein optimales Koppelverhalten bei rechtwinkliger Strahlablenkung in diesem Übergangsbereich des zu der Oberfläche des Messobjektes gelenkten und von dieser zurückkehrenden Messstrahls erreicht, wodurch die Genauigkeit der Messung insbesondere in unzugänglichen engen Hohlräumen wesentlich begünstigt wird.

Eine weitere Verbesserung insbesondere bei nummerischer Apertur der betreffenden Lichtleitfaser von 0,12 wird dadurch erreicht, dass der Neigungswinkel mindestens 48° beträgt.

Weiterhin werden Störungen dadurch unterdrückt, dass eine mantelseitige Umhüllung eines objektseitigen Endabschnittes der Sonden-Lichtleitfasereinheit mit einer Antireflexionsbehandlung versehen ist.

Weitere Möglichkeiten, die Kopplung der Strahlung zu verbessern, bestehen darin, dass die Austrittsfläche mit einer Reflexionsbehandlung versehen ist.

Für den Aufbau und die Funktion ist eine Ausgestaltung in der Weise vorteilhaft, dass ein teildurchlässiger Bereich zwischen einer Sondenfaser und einem FaserWO 2004/029544 PCT/DE2003/001032

6

abschnitt der Messsonde mittels einer bezüglich der optischen Sondenachse unter einem Austrittswinkel schrägen Austrittsfläche einer Sondenfaser und einer ebenfalls bezüglich der optischen Sondenachse unter einem Eintrittswinkel schrägen Eintrittsfläche eines objektseitig folgenden Faserabschnitts gebildet ist, wobei zwischen der Austrittsfläche und der Eintrittsfläche ein keilförmiger Spalt gebildet ist und wobei die Austrittsfläche und die Eintrittsfläche in gleicher Richtung bezüglich der Sondenachse geneigt sind.

5

10

15

20

25

30

Hierbei bestehen vorteilhafte Maßnahmen darin, dass der Austrittswinkel und der Eintrittswinkel so gewählt sind, dass eine Fresnel-Reflexion bewirkt wird.

Die Strahlungsübertragung für zuverlässige Messergebnisse wird dadurch begünstigt, dass der Austrittswinkel α zwischen 5° und 8° und der Eintrittswinkel zwischen α und 0° beträgt.

Ein weiterer vorteilhafter Aufbau besteht darin, dass die Sondenfaser und der Faserabschnitt in einer röhrchenförmigen Aufnahme axial ausgerichtet aufgenommen sind, die von einem äußeren Tubus der Messsonde umgeben ist, dass auf der von dem Messobjekt abgelegenen Stirnseite der Aufnahme ein die Sondenfaser umgebendes, ebenfalls zu dem Tubus konzentrisch aufgenommenes Positionierstück vorgesehen ist und dass der Faserabschnitt in dem objektseitigen, vorderen Teil der Aufnahme und die Sondenfaser in dem objektabgelegenen, hinteren Teil der Aufnahme und/oder dem Tubus fixiert ist.

Ein günstiger Aufbau wird desweiteren dadurch erreicht, dass der vordere Teil der Aufnahme von dem hinteren Teil der Aufnahme durch diametral gegenüber-

liegende Spalte getrennt ist, wobei der eine Spalt rückseitig in Verlängerung der schrägen Austrittsfläche der Sondenfaser und der andere Spalt vorderseitig in der Verlängerung der schrägen Eintrittsfläche begrenzt sind, dass der vordere Teil und der hintere Teil der Aufnahme von einem gemeinsamen hülsenförmigen Haltering umgeben sind, der auf seiner Außenseite von dem Tubus umgeben ist und dass ein vorderer Abschnitt des Faserabschnittes gegenüber dessen hinterem Abschnitt einen geringeren Durchmesser besitzt.

Zu einem vorteilhaften Aufbau und einer zuverlässigen Funktion tragen weiterhin die Maßnahmen bei, dass das Modulationsinterferometer zumindest teilweise eine polarisationserhaltende lichtleitende Struktur in Form eines optischen Faserleiters oder einer integrierten Optik aufweist, wobei die lichtleitende Struktur zumindest eines Arms aufgetrennt ist.

Zeichnung

5

10

15

20

25

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Gesamtaufbaus einer interferometrischen Messeinrichtung mit Modulationsinterferometer und Messsonde, WO 2004/029544 PCT/DE2003/001032

8

- Fig. 2 eine nähere Ausgestaltung des in Fig. 1 gezeigten Modulationsinterferometers,
- Fig. 3 die Messsonde und das Messobjekt in seitlicher Ansicht mit Darstellung des Strahlungsversatzes,
- Fig. 4 eine schematische Darstellung eines Faserteils der Messsonde in seitlicher Ansicht,
- Fig. 5 den vorderen Abschnitt der Messsonde in schematischer seitlicher Darstellung und
- Fig. 6 ein weiteres Ausführungsbeispiel des vorderen Abschnittes der Messsonde in schematischer seitlicher Darstellung.

Ausführungsbeispiel

5

10

15

20

25

Wie Fig. 1 zeigt, weist die auf dem Prinzip der Heterodyninterferometrie beruhende interferometrische Messeinrichtung eine breitbandige, kurzkohärente Lichtquelle 1 auf, deren Strahlung einem sogenannten Modulationsinterferometer 2 zugeführt wird. In dem Modulationsinterferometer 2, das in Fig. 2 näher dargestellt ist, wird die Strahlung s(t) an einem ersten Strahlteiler 2.3 in einen über einen ersten Arm geführten ersten Teilstrahl 2.1 mit einer Teilstrahlung s₁(t) und einen über einen zweiten Arm geführten zweiten Teilstrahl 2.1' mit einer Teil-

10

15

20

25

strahlung s₂(t) aufgeteilt und ausgangsseitig an einem weiteren Strahlteiler 2.10 wieder zusammengeführt und von dort über eine Lichtleitfaseranordnung 6 in eine entfernte Messsonde 3 geleitet. Von der Messsonde 3, die z.B. als Fizeau-Interferomter oder Mirau-Interferometer aufgebaut ist, wie in den eingangs genannten Druckschriften näher erläutert, gelangt die Strahlung anschließend über eine weitere Lichtleitfaseranordnung 7 in eine Empfängervorrichtung 4 mit einer Strahlzerlegungseinheit 4.1 und anschließenden photoelektrischen Empfängern 4.2, in denen eine Umwandlung in elektrische Signale erfolgt. In einer anschließenden Auswerteeinheit 5 mit Phasendetektor 5.1 und Recheneinheit 5.2 werden dann die mittels der Messsonde 3 aufgenommenen Eigenschaften der Messoberfläche (z.B. Rauhigkeit, Form, Abstände) ermittelt.

Das Modulationsinterferometer 2 ist als Mach-Zehnder-Interferometer aufgebaut, wobei die beiden Arme im Anschluss an den ersten Strahlteiler 2.3 erste bzw. zweite eingangsseitige Lichtleitfasern 2.11, 2.11' und erste bzw. zweite ausgangsseitige Lichtleitfasern 2.12, 2.12' aufweisen, die zu dem weiteren Strahlteiler 2.10 führen. Der erste Strahlteiler 2.3 ist dabei in einem Faserlichtleiter ausgebildet, mit dem die von der Lichtquelle 1 kommende Strahlung herangeführt wird. Am Ausgang des so gebildeten Kopplers werden die Teilstrahlen mittels linsenartiger Koppelelemente 2.4, 2.4' kollimiert, und die beiden kollimierten Teilstrahlen durchlaufen eine erste bzw. zweite Modulationseinheit 2.2, 2.2', beispielsweise in Form eines akustooptischen Modulators, eines faseroptischen Piezomodulators oder eines thermischen Phasenmodulators, wobei die Modulationseinheiten 2.2, 2.2' vorteilhaft auch als integrierte optische Bauteile ausgebildet sein können. Um die chromatische Dispersion zu korrigie-

ren, durchläuft zumindest einer der Teilstrahlen 2.1, 2.1' eine Glasplatte 2.7', die in einer ersten bzw. zweiten Lichtstrecke 2.5, 2.5' angeordnet ist. Die Wahl zur Anordnung der Glasplatte 2.7' und/oder auch deren Dicke bestimmt sich durch Rechnung. Im weiteren Verlauf werden der erste Teilstrahl 2.1 und der zweite Teilstrahl 2.1' auf ein erstes bzw. zweites linsenartiges Lichtleitelement 2.6, 2.6' geleitet und in die erste bzw. zweite ausgangsseitige Lichtleitfaser 2.12, 2.12' eingekoppelt. Die erste oder die zweite ausgangsseitige Lichtleitfaser 2.12, 2.12' besitzt eine größere optische Weglänge als die andere Lichtleitfaser in dem Ausmaß, dass der optische Wegunterschied $\Delta L = L_2 - L_1$ zwischen den beiden Armen größer ist als die Kohärenzlänge der kurzkohärenten Strahlung s(t) nach Durchlaufen der Filter 4.3 und 4.3'. Eines der linsenartigen Koppelelemente 2.4, 2.4' oder der Lichtleitelemente 2.6, 2.6', beispielsweise das Lichtleitelement 2.6' kann an einer Justiervorrichtung befestigt sein, mit der die optische Wegdifferenz AL von Hand oder mit einem Motor z.B. unter Benutzung eines Mikrometertisches in der Weise verstellt werden kann, dass die Wegdifferenz AL zwischen den beiden Armen auf diejenige der Messsonde 3 abgestimmt wird, um mit der Messsonde 3 eine Interferenz zu bewirken. Die verwendeten Lichtleitphasern 2.11, 2.11', 2.12, 2.12' sind monomod. Außerdem sind sie vorteilhafterweise polarisationserhaltend, insbesondere, wenn die Lichtquelle 1 polarisiert ist und/oder wenn die Modulationseinheiten 2.2, 2.2' aus doppelbrechenden Kristallen gebildet sind und/oder wenn die Montage an den Koppelstellen keine befriedigende Stabilität bezüglich der Polarisationsrichtungen in den beiden Interferometerarmen ergibt. Zum Erzielen der optischen Wegdifferenz ist beispielsweise in der zweiten ausgangsseitigen Lichtleitfaser 2.12' ein optischer Umweg 2.9' vorgesehen.

25

5

10

15

20

10

15

20

25

30

Die zum Aufnehmen der Objektoberfläche dienende Sonde 3, die beispielsweise als Fizeau-Interferometer oder Mirau-Interferometer aufgebaut ist, weist einen Referenzzweig mit einer Referenzebene und einen zu der Objektoberfläche führenden Messzweig auf, deren optischen Wegdifferenzen so gewählt sind, dass die in dem Modulationsinterferometer 2 erzeugte optische Wegdifferenz kompensiert wird, so dass der von der Objektoberfläche kommende Messstrahl und der von der Referenzebene kommende Referenzstrahl bei ihrer Überlagerung interferieren. Die interferierende Strahlung wird zur spektralen Aufteilung in Anteile unterschiedlicher Wellenlängen der Strahlzerlegungseinheit 4.1 und anschließend den zugeordneten photoelektrischen Empfängern 4.2 zugeführt. Aus der interferierenden Strahlung und den daraus gewonnen elektrischen Signalen wird durch Auswertung der Phasendifferenzen die gewünschte Oberflächeneigenschaft mittels des Phasendetektors 5.1 und der anschließenden Recheneinheit 5.2 ermittelt. Dabei entsteht die ausgewertete Phasendifferenz durch die mit der ersten und/ oder zweiten Modulationseinheit 2.2, 2.2' erzeugte Frequenzdifferenz, die entsprechend dem Heterodynverfahren bezogen auf die Grundfrequenz relativ gering ist. Die Berechnung erfolgt aufgrund der Beziehung:

$$\Delta \varphi = 2\pi \cdot (2e/\Lambda) + \varphi_0$$

wobei

 φ_{0} eine Konstante,

 $\Lambda = \lambda_1 \cdot \lambda_2 / (\lambda_2 - \lambda_1)$ synthetische Wellenlänge der Messvorrichtung

1 Wellenlänge an einem ersten photoelektrischen Empfänger

 λ_2 Wellenlänge an einem zweiten photoelektrischen Empfänger

e Messabstand

sind. Daraus wird mittels der Auswerteeinheit 5 der jeweils erfasste Abstand der Oberfläche an einer Messstelle bestimmt aus der Beziehung:

$$e = \Delta \varphi/(2 \pi) \cdot (\Lambda/2)$$
.

5

10

15

20

25

Das Abstandsmaß e wird also bestimmt aus einer Messung der Phase zwischen zwei elektrischen Signalen, wodurch die Messung unabhängig von der durch die Photodioden empfangenen optischen Intensität ist.

Fig. 3 zeigt einen Faserteil der Messsonde, ausgeführt als Mirau-Interferometer mit einer monomoden Lichtleitfaser, und die Wegverschiebungen der ankommenden s₂(t) und s₁(t) sowie der von der Oberfläche des Messobjektes 8 und einem teildurchlässigen Bereich 3.3 zwischen einer objektseitigen Austrittsfläche 3.31 einer Sondenfaser 3.1 und einer objektabgelegenen Eintrittsfläche 3.32 eines Faserabschnittes 3.2 zurücklaufenden Strahlungsanteile r₁'(t), r₁(t), r₂(t) und r2'(t). Die zurücklaufenden Strahlungsanteile r1'(t) und r1(t) ergeben sich dabei aus derjenigen Strahlung s1(t), die den Zweig des Modulationsinterferometers 2 ohne Umweg durchlaufen haben, wobei der Strahlungsanteil $r_1'(t)$ von dem teildurchlässigen Bereich 3.3 und der Strahlungsanteil r1(t) von der Oberfläche des Messobjektes 8 reflektiert werden. Die zurücklaufenden Strahlungsanteile r₂(t) und r2'(t) hingegen ergeben sich aus derjenigen Strahlung s2(t) des Modulationsinterferometers 2, die den optischen Umweg durchlaufen hat, wobei der zurücklaufende Strahlungsanteil r2(t) an dem teildurchlässigen Bereich 3.3 und der zurücklaufende Strahlungsanteil r2'(t) an der Oberfläche des Messobjektes 8 reflektiert worden ist. Es zeigt sich, dass entsprechend der Kompensation der in WO 2004/029544 PCT/DE2003/001032

dem Modulationsinterferometer 2 gebildeten Wegdifferenz ΔL durch die Messsonde 3 lediglich die zurücklaufenden Strahlungsanteile $r_1(t)$ und $r_2(t)$ innerhalb der Kohärenzlänge liegen und miteinander interferieren.

Die objektseitige Austrittsfläche 3.4 des Faserabschnittes 3.2 ist bei dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 3 vorzugsweise unter einem Winkel von 45° bezüglich der optischen Sondenachse 3.5 geneigt. Auf der Austrittsfläche 3.4 ist eine reflektierende metallische oder dielektrische Beschichtung aufgebracht. Die Strahlung wird auf diese Weise im Wesentlichen rechtwinklig abgelenkt und auf die umgebende Oberfläche des Objekts gelenkt und die von der Oberfläche reflektierte Strahlung tritt über die Austrittsfläche 3.4 wieder in die Lichtleitfaser ein.

Wie die Fig. 4 bis 6 zeigen, ist der teildurchlässige Bereich 3.3 zwischen der Austrittsfläche 3.31 der Sondenfaser 3.1 und der Eintrittsfläche 3.32 des Faserabschnittes 3.2 durch eine Neigung der Austrittsfläche 3.31 um einen Winkel α bezüglich der Normalen der Sondenachse 3.5 und durch eine Neigung der Eintrittsfläche 3.32 des Faserabschnittes 3.2 um einen Winkel β bezüglich der Normalen der Sondenachse 3.5 gebildet, wobei der Winkel α größer ist als der Winkel β und sich ein keilförmiger Spalt zwischen der Austrittsfläche 3.31 und der Eintrittsfläche 3.32 ergibt. Die Ausrichtung der Neigung bezüglich der Normalen ist bei der Austrittsfläche 3.31 und der Eintrittsfläche 3.32 im Längsschnitt in gleicher Weise zum Objekt hin orientiert. Der Winkel α der Austrittsfläche 3.31 ist so gewählt, dass der Strahlungsstrom der Fresnel-Reflexion auf der Austrittsfläche 3.31 nicht durch die Sondenfaser 3.1 geführt wird. Für eine monomode Lichtleitfaser mit einer nummerischen Apertur von

0,12 beträgt der Winkel α vorteilhaft etwa 6°. Der Winkel β ist so gewählt, dass der Strahlungsstrom der Fresnel-Reflexion auf die Eintrittsfläche 3.32 des Faserabschnittes 3.2 durch die Sondenfaser 3.1 geführt wird, wobei das Ausmaß des Strahlungsstromes berücksichtigt wird, das in die Sondenfaser 3.1 eingekoppelt werden soll. Wenn der Winkel β gleich 0 ist, beträgt die Kopplungsrate etwa 3,6 %. Wenn der Winkel β gegen den Winkel α geht, strebt der Kopplungsgrad gegen 0..Wenn der Winkel β gegen den Winkel α strebt, geht die Transmission für diesen Übergang und eine zurückkehrende Strahlung gegen 86 %. Ist hingegen der Winkel β gleich 0, beträgt die Transmission etwa 60 %. Eine nummerische Apertur von 0,12 ergibt sich z.B. bei einer Wellenlänge von 1.550 nm und einem Durchmesser von 10,4 μ m. Der Winkel α sollte nicht kleiner als etwa 5° gewählt werden.

Die Reflexionsbehandlung der Austrittsfläche 3.4 des Faserabschnittes 3.2 kann verringert oder vermieden werden, wenn der Austrittswinkel y zum Erreichen einer Totalreflexion an der Austrittsfläche 7 vergrößert wird. Dies ist z.B. bei einer monomoden Lichtleitfaser mit einer nummerischen Apertur von 0,12 bei einem Austrittswinkel y oberhalb von 48° der Fall.

Außenbehandlung (cladding) eine Antireflexionsbehandlung 3.22 vorgenommen werden, um die Empfindlichkeit gegenüber der Fresnel-Reflexion zu verringern oder der Austrittswinkel y kann soweit vergrößert werden, dass der Strahlungsstrom dieser Reflexion nicht mehr in den Faserabschnitt 3.2 eingekoppelt wird.

25

5

10

15

20

WO 2004/029544 PCT/DE2003/001032

Wie Fig. 5 zeigt, können die Sondenfaser 3.1 und der Faserabschnitt 3.2 in derselben röhrchenartigen Aufnahme 3.6 aufgenommen und in Kontakt gebracht werden. Die Aufnahme 3.6 ist die gleiche, wie sie für Verbinder monomoder Lichtleitfasern verwendet wird. Die Aufnahme 3.6 ist in einen sie umgebenden Tubus 3.9 der Messsonde 3 eingesetzt. Im Inneren des Tubus 3.9 befindet sich auf der objektabgelegenen Stirnseite der Aufnahme 3.6 anschließend ferner ein Positionierstück 7 für die Führung und Vorjustierung der Sondenfaser 3.1. Der Faserabschnitt 3.2 ist im Inneren der Aufnahme mittels Klebers 3.8' fixiert, während die Sondenfaser 3.1 in der Aufnahme 3.6 und/oder dem Positionierstück 3.7 mittels Klebers 3.8 fixiert ist.

Eine andere Vorgehensweise zum Ausrichten und Festlegen der Sondenfaser 3.1 und des Faserabschnittes 3.2 in der Sonde 3 ist in Fig. 6 gezeigt. Die Sondenfaser 3.1 wird in einen hinteren Abschnitt 3.6' der röhrchenförmigen Aufnahme 3.6 eingeführt und die vordere Stirnseite des Aufnahmenabschnittes 3.6' und der Austrittsfläche 3.31 der Sondenfaser 3.1 werden im gewünschten Winkel poliert, wobei die vordere Stirnseite im Bereich der vordersten Kante der Sondenfaser 3.1 normal zur optischen Achse 3.5 der Sondenfaser 3.1 gerichtet ist. Entsprechend wird die hintere Stirnseite eines vorderen Abschnittes 3.6" der Aufnahme 3.6 entsprechend der gewünschten Eintrittsfläche 3.32 des Faserabschnittes 3.2 poliert, wobei der an den hintersten Rand des Faserabschnittes 3.2 angrenzende Bereich der hinteren Stirnseite des vorderen Abschnittes 3.6" der Aufnahme 3.6 normal zur optischen Achse 3.5 der Sondenfaser 3.1 ausgerichtet ist. Zwischen dem hinteren Abschnitt 3.6' und dem vorderen Abschnitt 3.6" der Aufnahme 3.6 ergibt sich dabei im Längsschnitt die in Fig. 6 gezeigte Anord-

10

15

20

25

nung. Die beiden Abschnitte 3.6' und 3.6" der Aufnahme 3.6 werden zueinander mit einem aufgebrachten, z.B. geschlitzten Haltering 3.10 axial ausgerichtet und in den Tubus 3.9 eingesetzt. In dem Tubus 3.9 ist desweiteren wiederum an die hintere Stirnseite der Aufnahme 3.6 angrenzend ein konzentrisches Positionierstück 3.7 zum Justieren und Vorfixieren der Sondenfaser 3.1 eingesetzt, wie bei dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 5. Auch die Fixierung der Sondenfaser 3.1 und des Faserabschnittes 3.2 mittels Klebers 3.8, 3.8' erfolgt entsprechend dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 5, wobei der Faserabschnitt 3.6 in dem vorderen Abschnitt 3.6" der Aufnahme 3.6 festgelegt wird.

Es ist auch möglich, die Abschnitte 3.6' und 3.6" der Aufnahme 3.6 dadurch auszurichten, dass sie in ein V-förmiges Profil eingebracht werden. Dadurch, dass die beiden Abschnitte 3.6', 3.6" der Aufnahme 3.6 getrennt eingebracht werden, kann das äußerste Ende der Messsonde 3 unbeweglich und entsprechend der Eigenschaft des Messobjektes geändert werden, wobei dieselbe Sondenfaser 3.1 beibehalten wird.

Wie die Fig. 4 bis 6 desweiteren zeigen, ist der äußere Abschnitt des Faserabschnittes 3.2 in seinem Durchmesser reduziert, so dass er auch in enge Löcher eines Messobjektes 8 eingeführt werden kann, deren Durchmesser weniger als 130 μ m beträgt. Üblicherweise beträgt der Durchmesser einer monomoden Lichtleitfaser mit Außenbehandlung (cladding) 125 μ m. Der Durchmesser kann mittels chemischer Behandlung mit einer entsprechenden Säure oder Hitzebehandlung verringert werden, um eine gewünschte Verjüngung 3.21 zu erhalten. Die antireflektierende Behandlung 3.22 ist dann im Bereich des Abschnittes

WO 2004/029544 PCT/DE2003/001032

17

geringeren Durchmessers vorgenommen. Auch diese Maßnahmen tragen dazu bei, zuverlässige Messungen auch in engen Vertiefungen eines Messobjektes 8 vornehmen zu können.

10

Ansprüche

5

10

15

1. Interferometrische Messvorrichtung zum Erfassen der Form, der Rauheit oder des Abstandes der Oberfläche eines Messobjektes (8) mit einem Modulationsinterferometer (2), dem von einer Strahlungsquelle (1) kurzkohärente Strahlung zugeführt wird und das einen ersten Strahlteiler (2.3) zum Aufteilen der zugeführten Strahlung in einen über einen ersten Arm geführten ersten Teilstrahl (2.1) und einen über einen zweiten Arm geführten zweiten Teilstrahl (2.1') aufweist, von denen der eine gegenüber dem anderen mittels einer Modulationseinrichtung (2.2, 2.2') in seiner Licht-Phase oder Lichtfrequenz verschoben wird und eine Verzögerungsstrecke (2.9') durchläuft, und die anschließend an einem weiteren Strahlteiler (2.10) des Modulationsinterferomters (2) vereinigt werden, mit einer von dem Modulationsinterferometer (2) räumlich getrennten und mit dieser über eine Lichtleitfaseranordnung (6) gekoppelten oder koppelbaren Messsonde (3), in der die vereinigten Teilstrahlen in einen durch eine Sonden-Lichtleitfasereinheit (3.1, 3.2) mit einer schrägen objektseitigen Austrittsfläche (3.4) zu der Oberfläche geführten Messstrahl und einen Referenzstrahl aufgeteilt und in der der an der Oberfläche reflektierte

10

15

20

25

Messstrahl $(r_1(t))$ und der an einer Referenzebene reflektierte Referenzstrahl $(r_2(t))$ überlagert werden, und mit einer Empfängervorrichtung (4) und einer Auswerteeinheit (5) zum Umwandeln der ihr zugeleiteten Strahlung in elektrische Signale und zum Auswerten der Signale auf der Grundlage einer Phasendifferenz, dadurch gekennzeichnet, dass der Neigungswinkel (y) der Austrittsfläche (3.4) gegenüber der

Normalen der optischen Sondenachse (3.5) mindestens 46° beträgt.

- Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Neigungswinkel (y) mindestens 48° beträgt.
- Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine mantelseitige Umhüllung (cladding) eines objektseitigen Endabschnittes der Sonden-Lichtleitfasereinheit (3.2) mit einer Antireflexionsbehandlung (3.22) versehen ist.
- Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass die Austrittsfläche (3.4) mit einer Reflexionsbehandlung versehen ist.
- Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass ein teildurchlässiger Bereich (3.3) zwischen einer Sondenfaser (3.1) und einem Faserabschnitt (3.2) der Messsonde (3) mittels einer bezüglich der optischen Sondenachse (3.5) unter einem Austrittswinkel (α) schrägen Austrittsfläche (3.31) einer Sondenfaser (3.1) und einer ebenfalls bezüglich der optischen Sondenachse (3.5) unter einem Eintrittswinkel (β) schrägen Eintrittsfläche (3.32) eines objektseitig folgenden Faserabschnitts (3.2) gebildet ist, wobei zwischen der Austrittsfläche (3.31) und der Eintrittsfläche (3.32) ein keilförmiger Spalt gebildet ist und die Austrittsfläche (3.31) und die Eintrittsfläche (3.32) in gleicher Richtung bezüglich der Sondenachse (3.5) geneigt sind.

15

10

5

Vorrichtung nach Anspruch 5,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass der Austrittswinkel (a) und der Eintrittswinkel (β) so gewählt sind,
 dass eine Fresnel-Reflexion bewirkt wird.

20

Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Austrittswinkel (a) zwischen 5° und 8° und der Eintrittswinkel
(β) zwischen α und 0° beträgt.

25

 Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Sondenfaser (3.1) und der Faserabschnitt (3.2) in einer röhrchenförmigen Aufnahme (3.6; 3.6', 3.6") axial ausgerichtet aufgenommen sind, die von einem äußeren Tubus (3.9) der Messsonde (3) umgeben ist,

dass auf der von dem Messobjekt (8) abgelegenen Stirnseite der Aufnahme (3.6; 3.6') ein die Sondenfaser (3.1) umgebendes, ebenfalls zu dem Tubus (3.9) konzentrisch aufgenommenes Positionierstück (3.7) vorgesehen ist und

dass der Faserabschnitt (3.2) in dem objektseitigen, vorderen Teil der Aufnahme (3.6; 3.6") und die Sondenfaser (3.1) in dem objektabgelegenen, hinteren Teil der Aufnahme (3.6; 3.6') und/oder dem Tubus (3.9) fixiert sind.

5

10

15

20

25

9. Vorrichtung nach Anspruch 8,

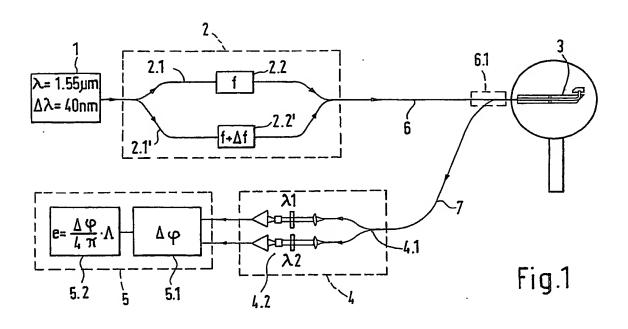
dadurch gekennzeichnet,

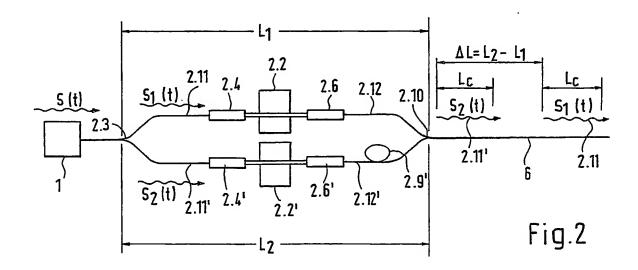
dass der vordere Teil der Aufnahme (3.6") von dem hinteren Teil der Aufnahme (3.6') durch diametral gegenüberliegende Spalte (3.61, 3.62) getrennt ist, wobei der eine Spalt (3.61) rückseitig in der Verlängerung der schrägen Austrittsfläche (3.31) der Sondenfaser (3.1) und der andere Spalt (3.62) vorderseitig in der Verlängerung der schrägen Eintrittsfläche (3.32) begrenzt sind,

dass der vordere Teil (3.6") und der hintere Teil (3.6') der Aufnahme von einem gemeinsamen hülsenförmigen Haltering (3.10) umgeben sind, der auf seiner Außenseite von dem Tubus (3.9) umgeben ist und dass ein vorderer Abschnitt des Faserabschnittes (3.2) gegenüber dessen hinterem Abschnitt einen geringeren Durchmesser besitzt.

10

- 10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass das Modulationsinterferometer (2) zumindest teilweis
 - dass das Modulationsinterferometer (2) zumindest teilweise eine polarisationserhaltende lichtleitende Struktur (2.11, 2.11', 2.12, 2.12') in Form eines optischen Faserleiters oder einer integrierten Optik aufweist, wobei die lichtleitende Struktur (2.11, 2.11' 2.12, 2.12') zumindest eines Arms aufgetrennt ist.





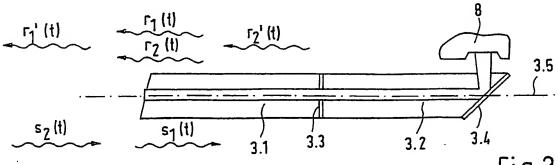
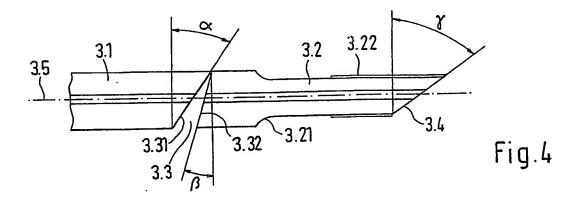
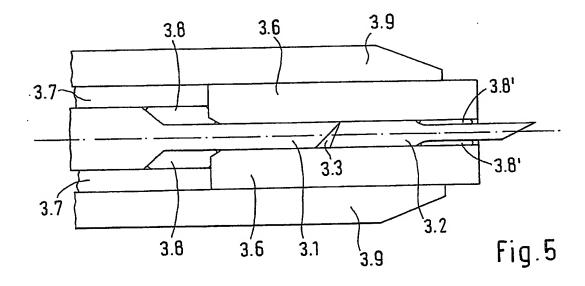
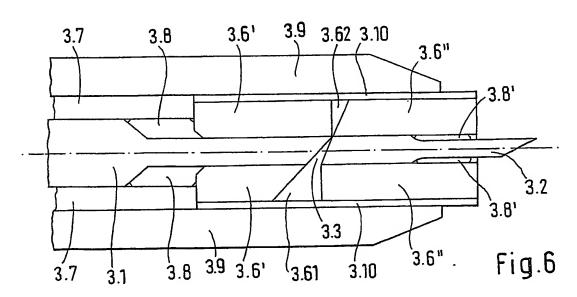


Fig.3







INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internation Application No PCT/DE 03/01032

A. CLASSIF IPC 7	G01B9/02					
	International Patent Classification (IPC) or to both national classification	on and IPC				
B. FIELDS	SEARCHED cumentation searched (classification system followed by classification	symbols)				
IPC 7	G01B	,				
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the extent that suc	ch documents are included in the fields se	arched			
Electronic da	ata base consulted during the International search (name of data base	and, where practical, search terms used)				
FPO-In	ternal, PAJ, WPI Data		·			
	,,					
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant	vant passages	Relevant to claim No.			
А	US 5 781 297 A (CASTORE GLEN) 14 July 1998 (1998-07-14) abstract; figure 1		1			
A	DE 100 57 539 A (BOSCH GMBH ROBER' 23 May 2002 (2002-05-23)	τ)	1			
	cited in the application abstract; figure 1					
A	DE 198 08 273 A (BOSCH GMBH ROBERT) 9 September 1999 (1999-09) cited in the application abstract; figure 1		1			
ļ		_				
]		••				
Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	in annex.			
° Special categories of cited documents: "T" later document published after the international filling date						
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention						
"E" earlier document but published on or after the international filing date		'X' document of particular relevance; the cannot be considered novel or canno				
which	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another n or other special reason (as specified)	involve an inventive step when the do 'Y' document of particular relevance; the	claimed invention			
"O" docum	ment referring to an oral disclosure, use, exhibition or means	cannot be considered to involve an in document is combined with one or me ments, such combination being obvio	ore other such docu-			
P document published prior to the international filing date but		in the art. *&* document member of the same patent family				
Date of the	actual completion of the International search	Date of mailing of the international se	arch report			
4 September 2003		12/09/2003				
Name and	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2	Authorized officer				
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.	Vorropoulos, G				
	Fax: (+31-70) 340-3016	,,				

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

insemation on patent family members

Internation Application No
PCT/DE 03/01032

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
US 5781297	Α	14-07-1998	NONE		
DE 10057539	A	23-05-2002	DE GB NL NL US	10057539 A1 2373853 A ,B 1019392 C2 1019392 A1 2002109847 A1	23-05-2002 02-10-2002 20-05-2003 22-05-2002 15-08-2002
DE 19808273	A	09-09-1999	DE WO DE EP JP	19808273 A1 9944009 A1 59903540 D1 1058812 A1 2002505414 T	09-09-1999 02-09-1999 09-01-2003 13-12-2000 19-02-2002

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internation es Aktenzelchen
PCT/DE 03/01032

a. Klassif IPK 7	izierung des anmeldungsgegenstandes G01B9/02			
Nach der inte	ernationalen Patentiklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifi	kation und der IPK		
	ICHIERTE GEBIETE			
	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) $601B$			
	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sowe			
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Nam	ne der Datenbank und evtl. verwendete St	ichbegriffe)	
EPO-In	ternal, PAJ, WPI Data			
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe o	der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.	
A	US 5 781 297 A (CASTORE GLEN) 14. Juli 1998 (1998-07-14) Zusammenfassung; Abbildung 1		1	
A	DE 100 57 539 A (BOSCH GMBH ROBERT 23. Mai 2002 (2002-05-23) in der Anmeldung erwähnt Zusammenfassung; Abbildung 1	')	1	
A	DE 198 08 273 A (BOSCH GMBH ROBERT 9. September 1999 (1999-09-09) in der Anmeldung erwähnt Zusammenfassung; Abbildung 1	T)	1	
	eitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu	X Siehe Anhang Patentfamilie		
 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelnaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem Internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung zugrundeilegenden Prinzips oder der ihr zugrundeilegenden Prinzips oder der ihr zugrundeilegenden Prinzips oder der ihr zugrundeilegenden Prinzips oder der Prioritätsdatum veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfin derischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden veröffentlichung on besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfin derischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden veröffentlichung en diener oder met veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfin derischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder met veröffentlichung erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden veröffentlichung erfinderischer Tätigkeit beru				
Datum de	as Abschlusses der Internationalen Recherche	Absendedatum des Internationalen Re	ecnerchendencius	
	4. ocpodiment zooo			
Name un	d Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk	Bevollmächtigter Bediensteter		
1	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fæc (+31-70) 340-3016	Vorropoulos, G		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, The zur selben Patentfamilie gehören

Internations Aktenzelchen
PCT/DE 03/01032

lm Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Mitglied(er) der Veröffentlichung Patentfamille		Datum der Veröffentlichung	
US 5781297	Α	14-07-1998	KEINE		
DE 10057539	Α	23-05-2002	DE GB NL NL US	10057539 A1 2373853 A ,B 1019392 C2 1019392 A1 2002109847 A1	23-05-2002 02-10-2002 20-05-2003 22-05-2002 15-08-2002
DE 19808273	A	09-09-1999	DE WO DE EP JP	19808273 A1 9944009 A1 59903540 D1 1058812 A1 2002505414 T	09-09-1999 02-09-1999 09-01-2003 13-12-2000 19-02-2002